

GaAs エッチング装置

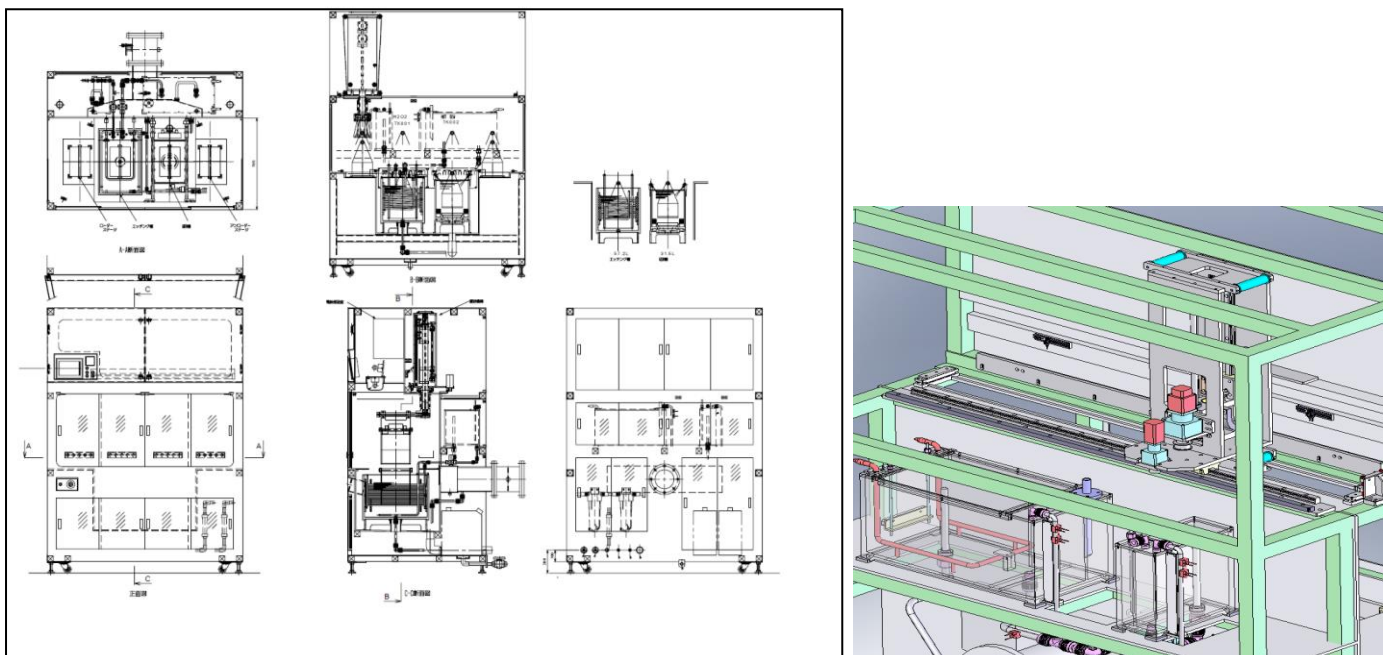
<概要>

本装置は GaAs ウェハを専用バスケットで自動搬送及びエッチングする装置です。ローダ部よりバスケットに入れた GaAs ウェハを投入すると、搬送機によりローダ部からエッチング槽、リンス槽、アンローダ部へと自動搬送されます。また、装置下側に薬液供給タンクがあり、自動で薬液を調合してエッチング槽に必要量投入します。

<主な仕様>

1. 被加熱物： GaAs (ガリウムと砒素) ブロック
2. カセット： PTFE 専用カセット
3. 搬送機： 自動ロボット搬送 (サーボモーター駆動)
4. 制御方式： シーケンサ制御

<外観図 (イメージ)>



<写真>



外観



搬送機